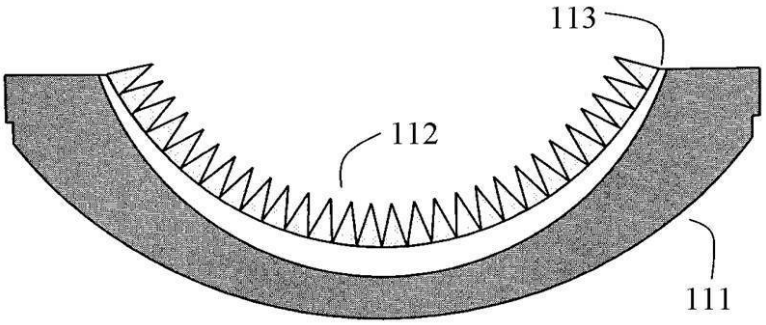
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成22年8月12日(2010.8.12)

【公開番号】特開2009-31610(P2009-31610A)
【公開日】平成21年2月12日(2009.2.12)
【年通号数】公開・登録公報2009-006
【出願番号】特願2007-196745(P2007-196745)
【国際特許分類】
Ｇ０２Ｂ　1/11　(2006.01)
Ｇ０２Ｂ　1/02　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０２Ｂ　1/10　A
Ｇ０２Ｂ　1/02

【手続補正書】
【提出日】平成22年6月25日(2010.6.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
微細構造を利用する反射抑制方法としては、入射光の波長より小さい粒径を有する微粒子を分散した膜を塗布する方法や(特許文献１参照)、微細パターン加工技術によって微細周期構造を形成する方法(特許文献２参照)がある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
また、最表層である第１の層０１２とこれに接する空気との屈折率差を小さくすることができるため、光学干渉の波の振幅を小さくすることができ、広帯域特性に優れた反射抑制機能を得ることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
このような屈折率構造では、入射光は第１の層０５２内で無数に干渉し合って第２の層０５３に入射する。この場合、従来の光学干渉膜とは異なり、屈折率の勾配と第１の層０５２の厚みとに対応して光が減衰しながら第２の層０５３に入射する。そこで、残留した光のベース部材０５１での反射を抑えるために、第２の層０５３の屈折率と厚さを調整することで、光学特性に優れた反射抑制構造が得られる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更

【補正の内容】
【００６３】
２３は固体撮像素子２２によって光電変換された被写体像に対応する情報を記録するメモリ、２４は液晶ディスプレイパネル等によって構成され、固体撮像素子２２上に形成された被写体像を観察するための電子ビューファインダである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１１】



【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１２】

